

DIN 32567-2:2014-10 (D)

Fertigungsmittel für Mikrosysteme - Ermittlung von Materialeinflüssen auf die optische und taktile dimensionelle Messtechnik - Teil 2: Prüfkörper für taktile Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Anforderungen an die Prüfkörper.....	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Anforderungen an die Abmessungen der Schicht	5
4.2.1 Mindestschichtdicke, -länge und -breite.....	5
4.3 Anforderungen an Ebenheit, Welligkeit und Rauheit von Schicht und Substrat	7
4.3.1 Allgemeines	7
4.3.2 Konstanz der Schichtdicke	7
4.3.3 Ebenheit des Substrates	7
4.3.4 Welligkeit des Substrates	8
4.3.5 Rauheit des Substrates.....	8
5 Prüfkörper für topografische Schichtdickenmessungen.....	8
5.1 Allgemeines	8
5.2 Messverfahren	9
5.3 Prüfkörper A.....	10
5.3.1 Allgemeines	10
5.3.2 Schichtsysteme der Testobjekte	10
5.3.3 Referenzobjekte.....	12
Literaturhinweise.....	13